



Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) デバイスの開発を設計・試作・評価までバックアップします

センター概要

兵庫県立大学MEMSデバイス開発支援センターは、4インチウエハ以下の口径試料の微細加工について、マスク作製から実装まで幅広い装置群を保有しています。これらの装置群の大半は2007~12年度に行われたJST ERATO前中センシング融合プロジェクトで導入されたものであり、プロジェクトで得られたプロセスノウハウや技術も含め、外部に公開することで社会還元することを意図しています。気軽にご利用いただけるよう、利用報告等の提出は不要であり、ふらっと来てMEMSプロセスを実施できるようなセンターを目指しています。

利用方法

★装置使用

・装置使用の流れ

- 1) ホームページで使用装置を選ぶ
2) 装置ごとのカレンダーで空き状況を確認
3) 機器使用連絡フォームに記入・送信
4) 予約成立メールを受け取る
5) 装置利用
6) AffordSNS社より使用料請求



Web site

・装置使用料

\* 装置はS~Cの4段階にカテゴライズされ、カテゴリごとに使用料金が設定されています。

(半日あたり30,000~10,000円, 税別)

\* 複数装置をご利用の場合: 1つの最上位カテゴリ料金に加え、2装置目以降の使用料は半額

\* 大学や公設試など非営利組織のご利用はカテゴリ使用料半額

\* 装置使用講習は別途6,000円/時が必要

\* 見積りや請求などの事務処理はAffordSNS社が行う

(手数料別途2割)

\* 消耗品は在庫利用可能 (使用量に応じて別途請求)。持込可

★依頼加工

特殊なプロセスも含めて依頼加工可能です。できる限り対応いたします。気軽にご相談ください

★サンプル提供

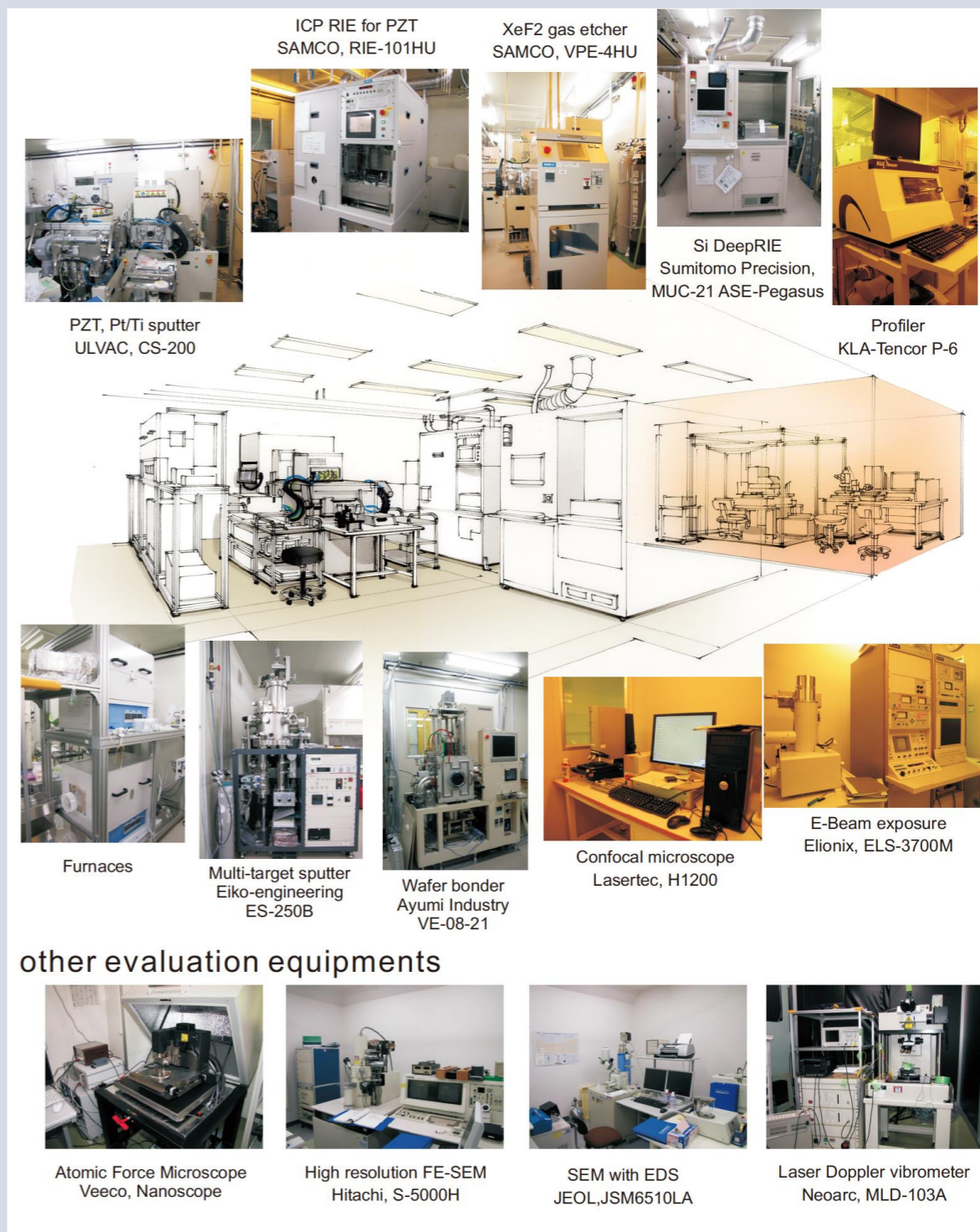
PZT薄膜やNdFeB薄膜などの特殊薄膜を成膜したウエハ (4インチ) のサンプル提供をしています (1枚10万円)

★MEMS講習

設計, プロセス, 評価を含む, 装置を用いた実習も承っています。気軽にご相談ください

代表的な装置

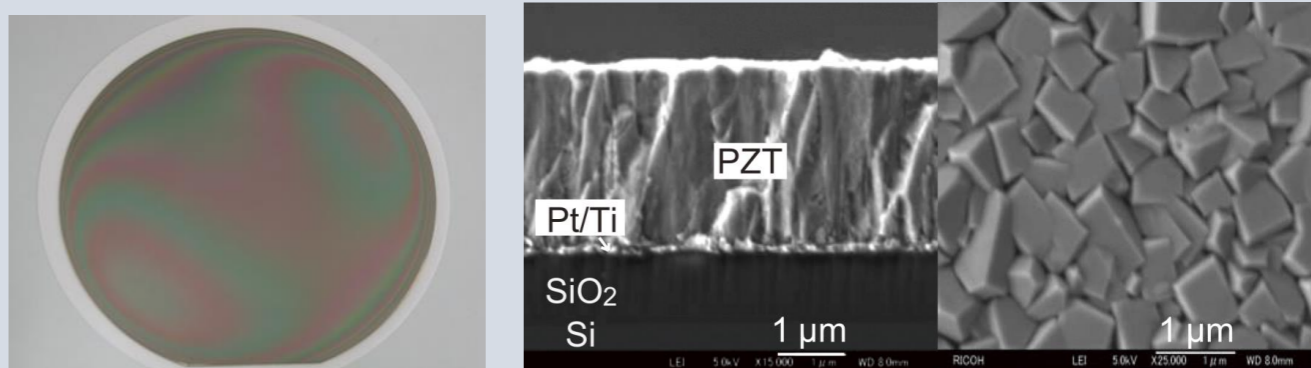
@姫路工学キャンパス



サンプル供給ウエハ (4インチ)

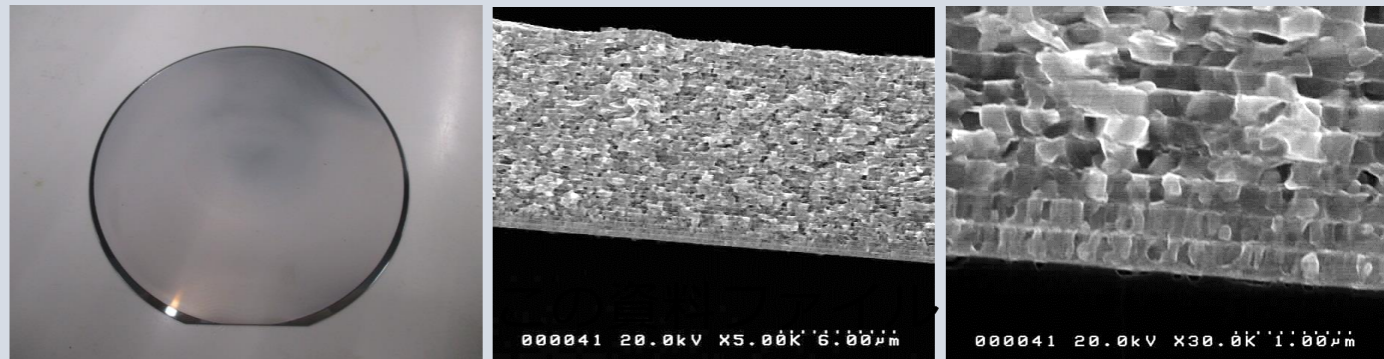
★PZT圧電薄膜

- ・ 膜厚1~10 μm
・ Gaianixx社のMEバッファ層による単結晶膜も可能



★NdFeB磁石薄膜

- ・ 膜厚10~20 μm
・ Ta/NdFeBの多層積層膜



問い合わせ・連絡先



Web site

https://d4uh.sakura.ne.jp/MEMSC/

兵庫県立大学大学院工学研究科MEMSデバイス開発支援センター

神田健介, 横松得滋, 前中一介

神田 kanda@eng.u-hyogo.ac.jp

横松 yokomatsu@eng.u-hyogo.ac.jp

前中 maenaka@eng.u-hyogo.ac.jp



ポスターDL